(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. September 2003 (12.09.2003)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/075423 A1

(51)	Internationale Patentklassifikation ⁷ : 5/42, H05B 33/08	H01S 5/068,	Berzeliusstrasse 83, 22093 Hamburg (DE), FRAUN- HOFER-GESELLSCHAFT [DE/DE]; Leonrodstrasse 54, 80636 München (DE).
(2I)	Internationales Aktenzeichen:	PCT/EP03/02016	(72) Erfinder; und
(22)	Internationales Anmeldedatum: 27. Februar	2003 (27.02.2003)	(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DINGER, Reinhold [DE/DE]; Theodor-Storm-Weg 5, 21509 Glinde (DE).

2. März 2002 (02.03.2002) DE

für US): DINGER, Reinhold Weg 5, 21509 Glinde (DE). HOFFMANN, Dieter [DE/DE]; Am Hammerwerk 20, 52152 Simmerath (DE), HAAS, Claus, Rüdiger [DE/DE]; Oppenhoffallee 88, 52066 Aachen (DE).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(25) Einreichungssprache:

102 09 374.1

(74) Anwalt: MÖRTEL & HÖFNER; Blumenstrasse 1. 90402 Nürnberg (DE).

(30) Angaben zur Priorität:

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROFIN-SINAR LASER GMBH [DE/DE];

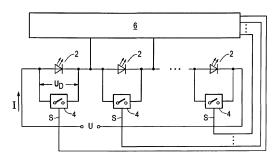
(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(54) Title: DIODE LASER ARRAY COMPRISING A PLURALITY OF ELECTRICALLY SERIES- CONNECTED DIODE LASERS

Deutsch

(54) Bezeichnung: DIODENLASERANORDNUNG MIT EINER MEHRZAHL VON ELEKTRISCH IN REIHE GESCHALTE-TEN DIODENLASERN



(57) Abstract: A diode laser array containing a plurality of electrically series-connected diode lasers (2) to which a bypass device (4) is respectively electrically and parallel connected. Said device is high-ohmic in normal operation and bypasses the respective diode laser (2) in the case of a diode laser diode defect leading to high-ohmic interruption of the electric circuit.

WO 03/075423 A1



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkarzungen wird auf die Erklärungen ("Gudance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zussammenfassung: Eine Diodenlassranordnung enthält eine Mehrzahl von elektrisch in Reibe geschalteten Diodenlassern (2), detene jeweils eine Bypsssanordnung (4) elektrisch prafullet geschaltet ist, die im Normalberrich benchening bit und den jeweiligen Diodenlasser (2) im Falle eines Diodenlasserdefektes, der zur hochohmigen Unter-Brechung des Stromkreises führt, niederohmig übertrückt.

Beschreibung

Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Rei-5 he geschalteten Diodenlasern

Die Erfindung bezieht sich auf eine Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern.

10

15

25

Hochleistungsdiodenlaser weisen eine Vielzahl möglicher Anwendungsgebiete auf, zu denen unter anderem das Pumpen von Festkörperlasern oder die Materialbearbeitung gehören. Ein Hochleistungsdiodenlaser enthält als laseraktives Element eine quaderförmige Halbleiterstruktur, den sogenannten Diodenlaserbarren, die aus mehreren, nebeneinander angeordneten, elektrisch parallel geschalteten Einzelemittern besteht. Ein solcher Diodenlaserbarren ist typischerweise etwa 10 mm lang, 0,3-2,0 mm breit und 0,1-0,15 mm hoch. Das in den pn-Übergängen erzeugte Laserlicht tritt an der Längsseite des Diodenlaserbarrens aus. Der Diodenlaserbarren ist zwischen einer Grund- und Deckplatte angeordnet, die sowohl zur elektrischen Kontaktierung als auch zur Kühlung dienen. Das Bauelement bestehend aus Diodenlaserbarren, elektrischen Kontakten und Kühlung wird als Diodenlaser bezeichnet. Die typischen optischen Ausgangsleistungen eines solchen Diodenlasers reichen, abhängig von Ausführung und Betriebsart, von ca. 1 W bis zu mehreren 100 W.

30 Zur weiteren Erhöhung der Ausgangsleistung werden mehrere Diodenlaser geometrisch nebeneinander (=horizontaler Stapel bzw. horizontaler Stack) und/oder übereinander (=vertikaler Stapel bzw. vertikaler Stack) angeordnet.

2

In einem solchen Stapel werden typischerweise etwa 2 bis zu einigen 100 Diodenlasern elektrisch in Reihe geschaltet. Beim Betrieb des Stapels kann es zum Ausfall einer oder mehrerer der im Stapel angeordneten Diodenlaser, beispielsweise durch spontane Zerstörung des Diodenlaserbarrens bzw. durch Versagen der elektrischen Kontaktierung des Diodenlaserbarrens, kommen. Durch einen solchen hochohmigen Defekt eines einzelnen Diodenlasers wird nun der durch die Reihenschaltung im Stapel fließende Strom unterbrochen, so dass der gesamte Stapel ausfällt. Es muss demzufolge wegen des Ausfalls eines einzigen Diodenlasers der gesamte Stapel ausgetauscht werden. Dies kann zu einem Betriebsausfall der gesamten Laseranlage führen, der mit einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden verbunden sein kann. Ein solcher Betriebsausfall könnte prinzipiell durch redundante Anordnungen mit parallelgeschalteten Diodenlaserstapeln vermieden werden. Dies würde jedoch zu erheblich höheren Kosten der Laserquelle führen.

- 20 Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde, eine Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern anzugeben, die auch bei Ausfall eines einzelnen Diodenlasers weiter betrieben werden kann.
- Die genannte Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst mit einer Diodenlaseranordnung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Da jedem der elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlaser zumindest eine Bypassanordnung elektrisch parallel geschaltet ist, die im Normalbetrieb hochohmig ist und den jeweiligen Diodenlaser im Falle eines hochohmigen Defektes niederohmig überbrückt, ist trotz des Ausfalls eines Diodenlasers sichergestellt, dass der Stromfluss durch die übrigen, zu dem ausgefallenen Diodenlaser in Reihe geschalteten Diodenlaser nicht

unterbrochen ist. Der gesamte Stapel kann mit nur vernachlässigbarer Leistungsverringerung weiter betrieben werden, so dass gegebenenfalls erforderliche Austausch- oder Reparaturarbeiten auf geplante Stillstandszeiten der mit dieser Diodenlaseranordnung bestückten Laseranlage verschoben werden können.

5

10

15

20

25

30

Optional kann der Diodenlaserstapel mit redundanten Diodenlasern bestückt werden oder eine Leistungsreserve vorgehalten werden, so dass die geplante Nennleistung des Diodenlaserstapels bei Ausfall einzelner Diodenlaser nicht unterschritten wird.

Die Begriffe "niederohmig" und "hochohmig" sind dabei folgendermaßen zu verstehen: Der Widerstand der Bypassanordnung ist im Normalbetrieb so groß, dass die Verlustleistung der Bypassanordnung kleiner ist als die Leistungsaufnahme des Diodenlasers. Vorzugsweise ist die Verlustleistung kleiner als 1/10 der Leistungsaufnahme. Im Überbrückungsfall sinkt der Widerstand der Bypassanordnung auf einen Wert, der die Größenordnung des Widerstandes des Diodenlasers im Normalbetrieb nicht wesentlich überschreitet, vorzugsweise deutlich niedriger als dieser ist. Dabei ist zu beachten, dass der Stromfluß sowohl im Diodenlaser als auch in der Bypassanordnung durch den ohmschen Widerstand und durch eine charakteristische Spannungsschwelle, die durch die Diffusionsspannung (im Fall einer Diodencharakteristik) oder die Zünd- oder Schwellwertspannung (im Fall von Thyristoren oder Transistoren) beeinflusst wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist eine selbstschaltende Bypassanordnung vorgesehen, wobei der Begriff selbstschaltend in dem Sinn zu verstehen ist, dass die Bypassanordnung ohne externe Steuerung zwangsläufig niederohmig

wird, wenn die Spannung über dem Diodenlaser einen Schwellwert überschreitet.

Als selbstschaltende Bypassanordnung ist vorzugsweise eine Di-5 ode oder eine aus einer Mehrzahl von Dioden aufgebaute Schaltung vorgesehen, die bei einer Spannung im Betriebsbereich des Diodenlasers hochohmig ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist eine 10 selbstschaltende Bypassanordnung vorgesehen, die als steuerbares Schaltelement einen Thyristor, oder eine aus mehreren Thyristoren aufgebaute Schaltung enthält. Der Thyristor ist ein steuerbarer Schalter mit 3 Anschlüssen: Anode und Kathode werden ähnlich einer Diode angeschlossen. Der Thyristor wird leitend, wenn der dritte Anschluß, der zur Steuerung dient, mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt wird, die größer ist als eine bauteilspezifische Schwellspannung. Diese Spannung wird vorteilhaft infolge des Spannungsanstiegs bei einem hochohmigen Diodenlaserdefekt an der Anode des Thyristors abgegriffen. Vorteilhaft an dieser Anordnung gegenüber einer ein-20 fachen Diode als Bypassanordnung ist deren erheblich niedrigere Verlustleistung. Da eine aus Dioden aufgebaute Bypassanordnung stets eine höhere Verlustleistung als der überbrückte Diodenlaser im Nennbetrieb aufweist, steigt die Leistungsaufnahme des Diodenlaserstapels nach einem Defekt gegenüber dem 25 Nennbetrieb an. Der Thyristorbypass weist dagegen eine niedrigere Verlustleistung als der überbrückte Diodenlaser auf, da die Betriebsspannung des Thyristors deutlich unter die Zündspannung sinken darf, ohne dass er wieder hochohmig wird. Dies führt zu einer erhöhten Lebensdauer des Bypasses, niedrigerem 30 Kühlaufwand und niedrigerer Energieaufnahme.

.

Besonders günstig ist es, wenn der Thyristor zuverlässig möglichst nahe oberhalb der maximalen Betriebsspannung des Diodenlasers zündet. Das hierzu erforderliche Schwellwertverhalten des Thyristors kann entweder durch geeignete Auslegung des Thyristors oder durch zusätzliche Elemente mit definiertem Schwellverhalten, z.B. durch eine Zenerdiode, erreicht werden.

Anstelle einer selbstschaltenden Bypassanordnung mit einem steuerbaren Schaltelement kann grundsätzlich das zum Schalten des steuerbaren Schaltelements erforderliche Steuersignal, im Falle eines Thyristors die Zündspannung, auch extern zugeführt werden.

Die Verwendung einer extern steuerbaren Bypassanordnung, ermöglicht den Aufbau einer Diodenlaseranordnung, die zusätzliche Diodenlaserbarren oder Diodenlaser enthält, die im Normalbetrieb ungenutzt, d. h. von der Bypassanordnung kurzgeschlossen sind. Im Falle eines Ausfalls eines Diodenlasers kann dieser überbrückt werden und der ungenutzte Diodenlaser durch

Öffnen des diesem zugeordneten Schaltelementes zugeschaltet
werden, so dass die Diodenlaseranordnung mit gleichen Betriebsparametern und gleicher Ausgangsleistung weiterbetrieben
werden kann.

- 25 In einer weiteren vorteilh\u00e4ften Ausgestaltung der Erfindung ist die Bypassanordnung zwischen den Kontakt- und K\u00fchlplatten des Diodenlasers angeordnet, dies erm\u00f6glicht eine einfache Integration der Bypassanordnung in den Stapel.
- 30 Die Kühlung des Bypass-Elementes erfolgt vorteilhaft auf gleichem Wege wie die Kühlung des zu überbrückenden Diodenlasers.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind die Bypassanordnung und der Diodenlaser auf einem Chip integriert. Auf diese Weise ist der Fertigungsaufwand bei der Herstellung eines Diodenlaserstapels verringert.

5

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Ausführungsbeispiele der Zeichnung verwiesen. Es zeigen:

Fig. 1 eine Diodenlaseranordnung gemäß der Erfindung in einem elektrischen Prinzipschaltbild,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Bypassanordnung,

Fig. 3 ein Diagramm, in dem die Strom-Spannungscharakteristik. für einen Diodenlaser und für die Bypassanordnung gemäß Fig. 2 dargestellt ist,

Fig. 4 ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel für eine

selbstschaltende Bypassanordnung,

20

Fig. 5 den Aufbau einer Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von aufeinander in einem Stapel angeordneten und elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern in einer Prinzipdarstellung.

25

Gemäß Fig 1 sind in einer Diodenlaseranordnung gemäß der Erfindung eine Mehrzahl von Diodenlasern 2 elektrisch in Reihe an eine Spannungsquelle U angeschlossen. Durch den auf diese Weise gebildeten Stapel, der bis zu mehrere hundert Diodenlaser 2 enthalten kann, fließt ein hoher elektrischer Strom I, der typischerweise zwischen 50 und 100 A beträgt. Im Normalbetrieb fällt dabei an jedem Diodenlaser 2 eine Spannung UD ab, die je nach Betriebsstrom und Diodenlaserausführung (z.B. Wel-

lenlänge) bei etwa 2 V liegt. Jedem Diodenlaser 2 ist eine Bypassanordnung 4 parallel geschaltet, die im Normalbetrieb (= nicht geschaltet, symbolisch veranschaulicht durch einen geöffneten Schalter) hochohmig ist, das heißt einen ohmschen Widerstand aufweist, der deutlich größer ist als der ohmsche Widerstand des Diodenlasers 2 bei dessen Normalbetrieb. Die Verlustleistungsaufnahme der nicht geschalteten Bypassanordnung ist somit kleiner als die Nenn-Leistungsaufnahme des Diodenlasers und beträgt vorzugsweise weniger als 1/10 der Leistungs-10 aufnahme des Diodenlasers 2.

Der hochohmige Ausfall eines einzelnen Diodenlasers 2 führt zu einer Unterbrechung des Diodenlaser-Stromkreises, so dass ohne Bypassanordnung 4 die gesamte Betriebsspannung U über dem ausgefallenen Diodenlaser 2 anstehen würde. In einem solchen Fall wird der betroffene Diodenlaser 2 durch die ihm zugeordnete Bypassanordnung 4 niederohmig überbrückt (die Bypassanordnung wird zugeschaltet), so dass der Stromfluss durch die übrigen Diodenlaser 2 in nahezu unveränderter Höhe aufrecht erhalten 20 wird. Unter dem Begriff "niederohmig" ist dabei ein Widerstandswert zu verstehen, der den Widerstand, den der Diodenlaser 2 im Normalbetrieb aufweisen würde, nicht wesentlich überschreitet. Besonders vorteilhaft sind Bypassanordnungen 4, deren Widerstand bei Ausfall des Diodenlasers 2 deutlich niedriger als der Widerstand des Diodenlasers im Normalbetrieb ist.

Als Bypassanordnung 4 ist grundsätzlich jede elektrische Schaltung geeignet, die die Funktion eines steuerbaren Schalters erfüllt, d. h. ein steuerbares Schaltelement, beispielsweise einen Transistor oder einen Thyristor, enthält. Das zur Steuerung erforderliche Steuersignal S kann dabei extern durch eine Steuer- und Auswerteeinrichtung 6 generiert werden, die

25

30

_

den an den Diodenlaser 2 jeweils anstehenden Spannungsabfall U_D überwacht und den ausgefallenen Diodenlaser 2 oder die ausgefallenen Diodenlaser 2 identifiziert. Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich, die Überwachung des korrekten Betriebs des jeweiligen Diodenlasers 2 auch innerhalb der Bypassanordnung 4 durchzuführen, d. h. das zum Steuern des steuerbaren Schaltelementes erforderliche Steuersignal S wird nicht extern sondern intern in der Bypassanordnung 4 generiert. Die Bypassanordnung 4 ist in diesem Fall selbstschaltend.

10

15

Mit einer extern steuerbaren Bypassanordnung 4 ist es möglich, gezielt einige der Diodenlaser 2 kurzzuschließen, um bei Ausfall eines oder mehrerer Diodenlaser 2 eine entsprechende Anzahl dieser kurzgeschlossenen Diodenlaser 2 durch Öffnen der Bypassanordnung 4 zuzuschalten.

Gemäß Fig. 2 ist als Bypassanordnung 4 eine aus mehreren Dioden 8 aufgebaute Schaltung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine aus passiven (nicht steuerbaren) Bauelementen aufge-20 baute selbstschaltende Bypassanordnung 4, die ohne aktive Bereitstellung eines externen oder internen Steuersignals im Fall eines Hochohmigwerdens des Diodenlasers selbst niederohmig wird. Mit der in der Figur dargestellten Reihenschaltung der Dioden 8 kann auf geeignete Weise eine Strom-Spannungs-Charakteristik erzeugt werden, wie sie in Fig. 3 dargestellt ist. In diesem Diagramm ist der Strom I, der durch das aus Diodenlaser 2 und der dazu parallel geschalteten Bypassanordnung 4 gebildete Bauteil fließt, gegen die Spannung UD aufgetragen. Kurve a zeigt die Strom-Spannungs-Charakteristik eines intakten Diodenlasers. Kurve b gibt die Strom-Spannungs-30 Charakteristik der aus einer Reihenschaltung von Dioden bestehenden Bypassanordnung 4 an. Die Bypassanordnung 4 muss dabei so dimensioniert sein, dass ihre Schwellspannung Us größer ist

als die maximale Betriebsspannung Umax des Diodenlasers. Mit anderen Worten: Die Bypassanordnung 4 ist im Betriebsbereich des Diodenlasers 2 hochohmig und wird bei Spannungen, die diesen Betriebsbereich überschreiten niederohmig. Dadurch entsteht im Betriebsbereich des Diodenlasers 2 in der Bypassanordnung 4 ein nur vernachlässigbarer ohmscher Verlust. Im Ausführungsbeispiel ist der differentielle Widerstand der Bypassanordnung 4 bei Ausfall des Diodenlasers 2 etwa gleich groß. Zur Aufrechterhaltung eines konstanten Stromflusses Io durch den Stapel muss die Spannung UD über dem aus defektem Diodenlaser 2 und Bypassanordnung 4 bestehenden Bauteil des Stapels etwas ansteigen. Entsprechend der höheren Potentialdifferenz UD.1 > UD.0 über dem Bauteil wird somit bei gleichem Strom I0 im Bauteil eine etwas höhere Leistung umgesetzt. Im Falle einer Regelung der Laserausgangsleistung des Diodenlaseranordnung wird der durch diese fließende Strom I zusätzlich etwas erhöht.

10

20

25

30

Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 enthält die Bypassanordnung 4 einen der Laserdiode 2 elektrisch parallel geschalteten
Thyristor 10 (p-Typ), dessen Gate (Steuerelektrode) über eine
Zenerdiode 12 an die Anode des Diodenlasers 2 angeschlossen
ist. Die Zenerdiode 12 verhindert ein Zünden des Thyristors 12
im Normalbetrieb. Steigt die Spannung an der Anode des Diodenlasers 2 infolge eines hochohmigen Defektes an und überschreitet die Zenerspannung der Zenerdiode 12, fließt ein Steuerstrom zum Gate des Thyristors 10, der dann zündet und die Laserdiode 2 überbrückt. In diesem Aufbau ist die Bypassanordnung 4 selbstschaltend und die Steuerelektrode des Thyristors
wird direkt (Schaltungsaufbau ohne Zenerdiode) oder indirekt
über die an der Laserdiode 2 anliegende Anodenspannung beeinflusst. Grundsätzlich kann jedoch das Gate des als steuerbaren

10

Schalter dienenden Thyristors auch über eine externe Steuerspannung geschaltet werden.

Gemäß Fig. 5 sind eine Mehrzahl von elektrisch in Reihe ge5 schalteten Diodenlasern 2 in einem Stapel angeordnet. Im Ausführungsbeispiel bilden die übereinander angeordneten Diodenlaser 2 ein vertikales Stack. Jeder Diodenlaser 2 umfasst einen Diodenlaserbarren 20, der sich zwischen metallischen, vorzugsweise aus Kupfer bestehenden Kontaktplatten 22 befindet,
die zugleich als Wärmesenken dienen und insbesondere im Hochleistungsbereich zusätzlich Mikrokanäle aufweisen und durch
ein Kühlfluid gekühlt werden. Der Diodenlaserbarren 20 ist
zwischen die Kontaktplatten 22 gelötet. Neben dem Diodenlaserbarren 20 ist in den Aufbau die Bypassanordnung 4 zwischen die
als p- bzw. n-Kontakt dienenden Kontaktplatten 10 eingelötet.

Bezugszeichenliste

	2	Diodenlaser
5	4	Bypassanordnung
	8	Dioden
	10	Thyristor
	12	Zenerdiode
	20	Diodenlaserbarren
10	22	Kontaktplatten
	$U_{\mathbf{S}}$	Schwellspannung
	\cdot Π^{D}	Spannung
15	U_{max}	maximale Betriebsspannung
	U	Spannungsquelle
	I	Strom

Ansprüche

5 1. Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern (2), denen jeweils eine Bypassanordnung (4) elektrisch parallel geschaltet ist, die im Normalbetrieb hochohmig ist und den jeweiligen Diodenlaser (2) im Falle eines hochohmigen Defektes niederohmig überbrückt.

10

30

- Diodenlaseranordnung nach Anspruch 1, bei der die Bypassanordnung (4) selbstschaltend ist.
- Diodenlaseranordnung nach Anspruch 2, bei der die Bypassanordnung (4) eine Diode oder eine Kombination mehrerer Dioden enthält, die bei einer Spannung im Betriebsbereich des Diodenlasers (2) hochohmig ist.
- 4. Diodenlaseranordnung nach Anspruch 2, bei der die Bypassanordnung (4) einen Thyristor (10) oder eine Kombination von Thyristoren enthält, deren Steuerelektrode direkt oder indirekt über die an der Anode des Diodenlasers (2) anliegende Anodenspannung beeinflusst wird.
- 5. Diodenlaseranordnung nach Anspruch 1, dessen Bypassanordnung (4) ein extern steuerbares Schaltelement (5) enthält.
 - 6. Diodenlaseranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bypassanordnung (4) zwischen den Kontaktplatten des Diodenlasers (2) angeordnet ist.

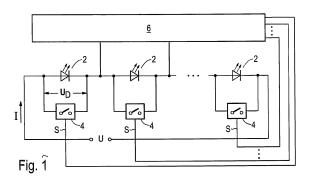
che, bei der die Bypassanordnung (4) und der Diodenlaser (2)

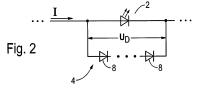
5 8. Diodenlaseranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bypassanordnung (4) und der Diodenlaser (2) als einzelne Bauelemente auf einem gemeinsamen Kühl- und Kontaktelement angeordnet sind.

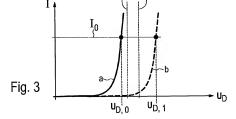
auf einem Chip integriert sind.

10

WO 03/075423 PCT/EP03/02016 1/2

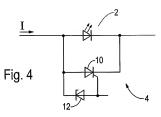


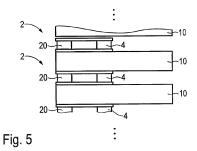




Umax

WO 03/075423 PCT/EP03/02016 2/2







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01S5/068 H01S5/42 H05B33/08

According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01S H01L H05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

Category a	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages	Relevani to daim No.
(EP 0 878 880 A (CONTRAVES AG) 18 November 1998 (1998-11-18) column 8, line 25 -column 9, figures 6,7	line 23;	1,5
X	GB 2 278 717 A (FUJITSU LTD) 7 December 1994 (1994-12-07) page 3, line 26 -page 6, line page 7, line 13 -page 11, line 1,7		1,5
X	US 6 259 714 B1 (KINBARA YOSH: 10 July 2001 (2001-07-10) column 4, line 60 -column 6, figures 1,5,8	,	1-3
X Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family membere are listed	in annex.
A* docume consid E* carlier of filling d		T later document published after the Inter- or priority date and not in conflict with clied to understand the principle or the invention 'X' document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	the application but sory underlying the laimed invention be considered to
which in citation of cocume other in the citation of the citat	nit which may throw doubts on priority, claim(s) or is clot do establish the publication date of another or other special reason (as specifico) and telerring to an oral disclosure, use, exhibition or reasons. The published prior to the international filling date but an the priority date claimed	involve an inventive step when the do "Y document of particular relevance; the cannot be considered to hydre an in deciment is combined with one or mi- ments, such combination being obvio- in the art. "8" document member of the same patent	laimed invention ventive step when the re other such docu- us to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international so:	erch report
_	June 2003	20/06/2003	
- 6			

Internst Application No PCT/EP 03/02016

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-3.5.8 vol. 2002, no. 05, 3 May 2002 (2002-05-03) -& JP 2002 025784 A (ISHIZAWA TAKASHI). 25 January 2002 (2002-01-25) abstract Υ DE 100 36 283 A (BOSCH GMBH ROBERT) 1.5.8 7 February 2002 (2002-02-07) column 1, line 19 -column 2, line 1 column 2, line 42 -column 3, line 6; claim 7; figures 3,4 Υ PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-3 vol. 008, no. 221 (E-271). 9 October 1984 (1984-10-09) -& JP 59 103565 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15 June 1984 (1984-06-15) abstract Α DE 198 41 490 A (SIEMENS AG) 1-3 23 March 2000 (2000-03-23) column 4, line 20 -column 7, line 66; figure 2 Α EP 0 967 590 A (HEWLETT PACKARD CO) 1,5 29 December 1999 (1999-12-29) column 5, line 16-57; figure 2 Α EP 0 129 498 A (SIEMENS AG) 1 27 December 1984 (1984-12-27) page 2, line 1-5 page 3, line 1 -page 4, column 2; figure 1

in ation on patent family members

ı	Internat	Application No	
	PCT/EP	03/02016	

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0878880	A	18-11-1998	CA DE EP JP US	2234854 A1 59800382 D1 0878880 A1 11026852 A 6018602 A	25-12-1998 18-01-2001 18-11-1998 29-01-1999 25-01-2000
GB 2278717	A	07-12-1994	JP JP US	2991893 B2 6338647 A 5459328 A	20-12-1999 06-12-1994 17-10-1995
US 6259714	B1	10-07-2001	JP CN DE TW US	11087817 A 1211093 A 19840514 A1 412890 B 6135552 A	30-03-1999 17-03-1999 18-03-1999 21-11-2000 24-10-2000
JP 2002025784	A	25-01-2002	NONE		
DE 10036283	A	07-02-2002	DE EP	10036283 A1 1182757 A2	07-02-2002 27-02-2002
JP 59103565 4	A		NONE		
DE 19841490	A	23-03-2000	DE	19841490 A1	23-03-2000
EP 0967590	A	29-12-1999	EP JP US	0967590 A1 2000029400 A 6239716 B1	29-12-1999 28-01-2000 29-05-2001
EP 0129498	А	27-12-1984	DE AT DE EP	3319779 A1 24789 T 3461959 D1 0129498 A1	29-11-1984 15-01-1987 12-02-1987 27-12-1984

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Betr. Anspruch Nr.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01S5/068 H01S5/42 H05B33/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikalionssystem und Klassifikalionssymbole)

IPK 7 H01S H01L H05B

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweill diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl., verwendete Suchbagriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle

X				
7. Dezember 1994 (1994–12–07) Set te 3, Zeite 12 65–Seite 15, Zeite 12 Set te 3, Zeite 12 65–Seite 11, Zeite 21; Abbildungen 1,7 X US 6 259 714 B1 (KINBARA YOSHIHIDE) 10. Juli 2001 (2001–07–10) Spalte 4, Zeite 60 – Spalte 6, Zeite 41; Abbildungen 1,5,8 ——/— Weiter Veröffentlichungen eind der Forisetzung von Feld Czu eränderhen	x	18. November 1998 (1998-11-18) Spalte 8, Zeile 25 -Spalte 9, Ze	ile 23;	1,5
10. Juli 2001 (2001–07–10) Spalte 4, Zeile 60 – Spalte 6, Zeile 41; Abbildungen 1,5,8 – — — — — — — — — — — — — — — — — — —	X	7. Dezember 1994 (1994-12-07) Seite 3, Zeile 26 -Seite 6, Zeile Seite 7, Zeile 13 -Seite 11, Zei		1,5
** Descrident Kategorien vom angegebenen Varöffertlichungen : **Werderfreitlichung, die den algemeinen Stand der Tachrik deffeitlichungen : **Werderfreitlichung, die den algemeinen Stand der Tachrik deffeitlichungen : **Werderfreitlichung, die den algemeinen Stand der Tachrik deffeitlichungen : **Verählend Einstellen des jeden der sich an der nacht dem Internationalen Annehäusen die gedegnet lat, einen Pfrüstlässensynch zweifelbeit ernanderen in Pfacherichtenbeitricht genausten Veröhlende Geranderen im Pfacherichtenbeitricht genausten Verählende Einstelle der anderen im Pfacherichtenbeitricht genausten Verählende Geranderen Der der Stander in der Stander verählende Geranderen Der der Standeren berühlt genausten Verählende Geranderen Der der Standeren berühlt genausten Verählende Geranderen Der der Standeren berühlt genausten Verählende Geranderen Der der der Standeren der Standeren der Verählende Geranderen Der der der Standeren der S	X	10. Juli 2001 (2001-07-10) Spalte 4, Zeile 60 -Spalte 6, Ze	·	1-3
*** Verdeffontlichung, die den algemeihen Sland der Tschrik offellert, noch mit als des besonders Kodersteinen muschsein ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am anzeisehen ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am anzeisehen ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am anzeisehen ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am anzeisehen ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am anzeisehen ist Fel dieses Dokumen, die jedoch ert am einer mit Fel dieses Dokumen, die gelagent ist, eine Mittellagen gestem diese Fel dieses dieses die gelagent ist, eine dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses dieses dieses Fel dieses dieses diese	in the second	ahmen		
1. Verderfinichtung die gleichen 14. dene Pferinklassensuch zweifehelt er anderen in Recherchenberidt gewahnt wet der auf verderen der den in Recherchenberidt gewahnt wet der lauf verderen der	'A' Verötfer aber n 'E' älteres i Anmel	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeulsam enzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	oder dem Prioritätsdatim veröffentlicht Anmeldung nicht kellidiert, sondern nu Erfindung zugrundelliogenden Prinzipa Theorie angegeben ist	worden ist und mit der rzum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden
6. Juni 2003 20/06/2003 Name und Prystanschift der Internationales Rochencheaberhörde Europäisches Patentamit, P.B. 5818 Patienthaan 2 N.L. 493-170 July-200-00, Tx. 31 651 epon II. Füx. (4-13-17) 340-340, Tx. 31 651 epon II. Füx. (4-13-17) 340-340, Tx. 31 651 epon II. Füx. (4-13-17) 340-340, Tx. 31 651 epon II.	'L' Veröffer schein andere soli od ausgel 'O' Veröffe eine B 'P' Veröffer	Illichung, die geeignet ist, einen Prörsitätenensruch zweilehelf er- en zul seisen, ohler durch die des Veröfentlichungstehten einer in im Recherchen bericht genannten Veröfentlichungs belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund engegeben ist (wie ührt) nichtung, die alch auf eine mändliche Offenberung, entutzung, eine Ausstellung oder andere Meßnahmen bezieht nichung, die voder miterationselne Ammeldechun, aber nach	kann albin aufgrund dieser Veröffentlich erinderischer Tälligkeit beruhend betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erflinderischer Tältigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbinzbing tier einen Fachmann	shurig nicht als neu oder auf chlot werden rtung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
Name und Postamochrift der Internationalen Röcherchenbehörde Europäisches Petentamit, P.B. 5918 Patentham 2 N.L. 22061/H (Fighter) Er (478 – 798 – 2000 Tr. 31 651 spen n. Ers (478 – 798 – 2000 Tr. 31 651 spen n. Ers (478 – 798 –	Datum des /	Abechlusees der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re-	cherchenberichls
Europäisches Patentami, P.B. 5918 Patentham 2 N. – 2904 htt Pijevije Tul. (+31-19) 240-2400, Tx. 31 651 spo ni, Ens. (+31-19) 240-2401 http://doi.org/10.1001/ Ens. (+			20/06/2003	
Fax: (+31-70) 340-3016 GHUGESSER, H	Name und F	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL 2280 HV Rijswijk		
		Fax: (+31-70) 340-3016	Gnugesser, H	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/02016

		03/02016
C.(Fortsetz Kategorie ^o	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
rutegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 05, 3. Mai 2002 (2002-05-03) -å JP 2002 025784 A (ISHIZAWA TAKASHI), 25. Januar 2002 (2002-01-25) Zusammenfassung	1-3,5,8
Y	DE 100 36 283 A (BOSCH GMBH ROBERT) 7. Februar 2002 (2002-02-07) Spalte 1, Zeile 19 -Spalte 2, Zeile 1 Spalte 2, Zeile 42 -Spalte 3, Zeile 6; Anspruch 7; Abbildungen 3,4	1,5,8
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 221 (E-271), 9. Oktober 1984 (1984-10-09) -å JP 59 103565 Å (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15. Juni 1984 (1984-06-15) ZUsammenfassung	1-3
A	DE 198 41 490 A (SIEMENS AG) 23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2	1-3
A	EP 0 967 590 A (HEWLETT PACKARD CO) 29. Dezember 1999 (1999-12-29) Spalte 5, Zeile 16-57; Abbildung 2	1,5
A	EP 0 129 498 A (SIEMENS AG) 27. Dezember 1984 (1984-12-27) Seite 2, Zeile 1-5 Seite 3, Zeile 1 -Seite 4, Spalte 2; Abbildung 1	1

INTERNATIONALER BECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen une zur selben Patentfamilie gehören



	lecherchenbericht irtes Patentdokumen	t	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0878880	A	18-11-1998	CA DE EP JP US	2234854 A1 59800382 D1 0878880 A1 11026852 A 6018602 A	25-12-1998 18-01-2001 18-11-1998 29-01-1999 25-01-2000
GB	2278717	Α	07-12-1994	JP JP US	2991893 B2 6338647 A 5459328 A	20-12-1999 06-12-1994 17-10-1995
US	6259714	B1	10-07-2001	JP CN DE TW US	11087817 A 1211093 A 19840514 A1 412890 B 6135552 A	30-03-1999 17-03-1999 18-03-1999 21-11-2000 24-10-2000
JP	2002025784	Α	25-01-2002	KEI	NE	
DE	10036283	A	07-02-2002	DE EP	10036283 A1 1182757 A2	07-02-2002 27-02-2002
JP	59103565 4	Α		KEI	NE	
DE	19841490	Α	23-03-2000	DE	19841490 A1	23-03-2000
EP	0967590	Α	29-12-1999	EP JP US	0967590 A1 2000029400 A 6239716 B1	29-12-1999 28-01-2000 29-05-2001
EP	0129498	A	27-12-1984	DE AT DE EP	3319779 A1 24789 T 3461959 D1 0129498 A1	29-11-1984 15-01-1987 12-02-1987 27-12-1984

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. September 2003 (12.09.2003)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2003/075423 A1

Berzeliusstrasse 83, 22093 Hamburg (DE). FRAUN-

HOFER-GESELLSCHAFT [DE/DE]: Leonrodstrasse

H01S 5/068, (51) Internationale Patentklassifikation7: 5/42, HO5B 33/08

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/002016 (72) Erfinder; und

54, 80636 München (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DINGER, Reinhold [DE/DE]; Theodor-Storm-Weg 5, 21509 Glinde (DE). HOFFMANN, Dieter [DE/DE]: Am Hammerwerk 20. 52152 Simmerath (DE). HAAS, Claus, Rüdiger | DE/DE |;

- (25) Einreichungssprache:
- Deutsch
 - Oppenhoffallee 88, 52066 Aachen (DE). (74) Anwalt: MÖRTEL & HÖFNER: Blumenstrasse 1. 90402 Nürnberg (DE).

(26) Veröffentlichungssprache:

(22) Internationales Anmeldedatum:

Deutsch

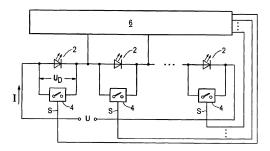
27. Februar 2003 (27.02.2003)

- (81) Bestimmungsstaaten (national); JP. US.
- (30) Angaben zur Priorität: 2. März 2002 (02.03.2002) DE 102 09 374.1
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CII, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROFIN-SINAR LASER GMBH [DE/DE];

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DIODE LASER ARRAY COMPRISING A PLURALITY OF ELECTRICALLY SERIES- CONNECTED DIODE LASERS

(54) Bezeichnung: DIODENLASERANORDNUNG MIT EINER MEHRZAHL VON ELEKTRISCH IN REIHE GESCHALTE-TEN DIODENLASERN



(57) Abstract: A diode laser array containing a plurality of electrically series-connected diode lasers (2) to which a bypass device (4) is respectively electrically and parallel connected. Said device is high-ohmic in normal operation and bypasses the respective diode laser (2) in the case of a diode laser diode defect leading to high-ohmic interruption of the electric circuit

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2003/075423 A1



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten Fassung: 2. September 2004

(15) Informationen zur Berichtigung: siehe PCT Gazette Nr. 36/2004 vom 2. September 2004, Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Gutdance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Eine Diodenlaseranordnung enthält eine Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern (2), denen jeweils eine Bypassanordnung (4) elektrisch parallel geschaltet ist, die im Normalbetrieb hochohmig ist und den jeweiligen Diodenlaser (2) im Falle eines Diodenlaserdefektes, der zur hochohmigen Unter-Brechung des Stromkreises führt, niederohmig überbrückt.

Beschreibung

Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Rei-5 he geschalteten Diodenlasern

Die Erfindung bezieht sich auf eine Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern.

10

ren 100 W.

Hochleistungsdiodenlaser weisen eine Vielzahl möglicher Anwendungsgebiete auf, zu denen unter anderem das Pumpen von Festkörperlasern oder die Materialbearbeitung gehören. Ein Hochleistungsdiodenlaser enthält als laseraktives Element eine quaderförmige Halbleiterstruktur, den sogenannten Diodenlaserbarren, die aus mehreren, nebeneinander angeordneten, elektrisch parallel geschalteten Einzelemittern besteht. Ein solcher Diodenlaserbarren ist typischerweise etwa 10 mm lang, 0,3-2,0 mm breit und 0,1-0,15 mm hoch. Das in den pn-Übergängen erzeugte Laserlicht tritt an der Längsseite des Diodenlaserbarrens aus. Der Diodenlaserbarren ist zwischen einer Grund- und Deckplatte angeordnet, die sowohl zur elektrischen Kontaktierung als auch zur Kühlung dienen. Das Bauelement bestehend aus Diodenlaserbarren, elektrischen Kontakten und Kühlung wird als Diodenlaser bezeichnet. Die typischen optischen Ausgangsleistungen eines solchen Diodenlasers reichen, abhängig von Ausführung und Betriebsart, von ca. 1 W bis zu mehre-

30 Zur weiteren Erhöhung der Ausgangsleistung werden mehrere Diodenlaser geometrisch nebeneinander (=horizontaler Stapel bzw. horizontaler Stack) und/oder übereinander (=vertikaler Stapel bzw. vertikaler Stack) angeordnet.

In einem solchen Stapel werden typischerweise etwa 2 bis zu einigen 100 Diodenlasern elektrisch in Reihe geschaltet. Beim Betrieb des Stapels kann es zum Ausfall einer oder mehrerer der im Stapel angeordneten Diodenlaser, beispielsweise durch spontane Zerstörung des Diodenlaserbarrens bzw. durch Versagen der elektrischen Kontaktierung des Diodenlaserbarrens, kommen. Durch einen solchen hochohmigen Defekt eines einzelnen Diodenlasers wird nun der durch die Reihenschaltung im Stapel fließende Strom unterbrochen, so dass der gesamte Stapel ausfällt. Es muss demzufolge wegen des Ausfalls eines einzigen Diodenlasers der gesamte Stapel ausgetauscht werden. Dies kann zu einem Betriebsausfall der gesamten Laseranlage führen, der mit einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden verbunden sein kann. Ein solcher Betriebsausfall könnte prinzipiell durch redundante Anordnungen mit parallelgeschalteten Diodenlaserstapeln vermieden werden. Dies würde jedoch zu erheblich höheren Kosten der Laserquelle führen.

20 Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde, eine Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern anzugeben, die auch bei Ausfall eines einzelnen Diodenlasers weiter betrieben werden kann.

Die genannte Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst mit einer Diodenlaseranordnung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Da jedem der elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlaser zumindest eine Bypassanordnung elektrisch parallel geschaltet ist, die im Normalbetrieb hochohmig ist und den jeweiligen Diodenlaser im Falle eines hochohmigen Defektes niederohmig überbrückt, ist trotz des Ausfalls eines Diodenlasers sichergestellt, dass der Stromfluss durch die übrigen, zu dem ausgefallenen Diodenlaser in Reihe geschalteten Diodenlaser nicht

unterbrochen ist. Der gesamte Stapel kann mit nur vernachlässigbarer Leistungsverringerung weiter betrieben werden, so dass gegebenenfalls erforderliche Austausch- oder Reparaturarbeiten auf geplante Stillstandszeiten der mit dieser Diodenlaseranordnung bestückten Laseranlage verschoben werden können.

Optional kann der Diodenlaserstapel mit redundanten Diodenlasern bestückt werden oder eine Leistungsreserve vorgehalten werden, so dass die geplante Nennleistung des Diodenlaserstapels bei Ausfall einzelner Diodenlaser nicht unterschritten wird.

Die Begriffe "niederohmig" und "hochohmig" sind dabei folgendermaßen zu verstehen: Der Widerstand der Bypassanordnung ist im Normalbetrieb so groß, dass die Verlustleistung der Bypassanordnung kleiner ist als die Leistungsaufnahme des Diodenlasers. Vorzugsweise ist die Verlustleistung kleiner als 1/10 der Leistungsaufnahme. Im Überbrückungsfall sinkt der Widerstand der Bypassanordnung auf einen Wert, der die Größenordnung des Widerstandes des Diodenlasers im Normalbetrieb nicht wesentlich überschreitet, vorzugsweise deutlich niedriger als dieser ist. Dabei ist zu beachten, dass der Stromfluß sowohl im Diodenlaser als auch in der Bypassanordnung durch den ohmschen Widerstand und durch eine charakteristische Spannungsschwelle, die durch die Diffusionsspannung (im Fall einer Diodencharakteristik) oder die Zünd- oder Schwellwertspannung (im Fall von Thyristoren oder Transistoren) beeinflusst wird.

15

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist eine selbstschaltende Bypassanordnung vorgesehen, wobei der Begriff selbstschaltend in dem Sinn zu verstehen ist, dass die Bypassanordnung ohne externe Steuerung zwangsläufig niederohmig

wird, wenn die Spannung über dem Diodenlaser einen Schwellwert überschreitet.

Als selbstschaltende Bypassanordnung ist vorzugsweise eine Di-5 ode oder eine aus einer Mehrzahl von Dioden aufgebaute Schaltung vorgesehen, die bei einer Spannung im Betriebsbereich des Diodenlasers hochohmig ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist eine 10 selbstschaltende Bypassanordnung vorgesehen, die als steuerbares Schaltelement einen Thyristor, oder eine aus mehreren Thyristoren aufgebaute Schaltung enthält. Der Thyristor ist ein steuerbarer Schalter mit 3 Anschlüssen: Anode und Kathode werden ähnlich einer Diode angeschlossen. Der Thyristor wird leitend, wenn der dritte Anschluß, der zur Steuerung dient, mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt wird, die größer ist als eine bauteilspezifische Schwellspannung. Diese Spannung wird vorteilhaft infolge des Spannungsanstiegs bei einem hochohmigen Diodenlaserdefekt an der Anode des Thyristors abgegriffen. Vorteilhaft an dieser Anordnung gegenüber einer einfachen Diode als Bypassanordnung ist deren erheblich niedrigere Verlustleistung. Da eine aus Dioden aufgebaute Bypassanordnung stets eine höhere Verlustleistung als der überbrückte Diodenlaser im Nennbetrieb aufweist, steigt die Leistungsaufnahme des Diodenlaserstapels nach einem Defekt gegenüber dem 25 Nennbetrieb an. Der Thyristorbypass weist dagegen eine niedrigere Verlustleistung als der überbrückte Diodenlaser auf, da die Betriebsspannung des Thyristors deutlich unter die Zündspannung sinken darf, ohne dass er wieder hochohmig wird. Dies führt zu einer erhöhten Lebensdauer des Bypasses, niedrigerem 30 Kühlaufwand und niedrigerer Energieaufnahme.

Besonders günstig ist es, wenn der Thyristor zuverlässig möglichst nahe oberhalb der maximalen Betriebsspannung des Diodenlasers zündet. Das hierzu erforderliche Schwellwertverhalten des Thyristors kann entweder durch geeignete Auslegung des 5 Thyristors oder durch zusätzliche Elemente mit definiertem Schwellverhalten, z.B. durch eine Zenerdiode, erreicht werden.

Anstelle einer selbstschaltenden Bypassanordnung mit einem steuerbaren Schaltelement kann grundsätzlich das zum Schalten des steuerbaren Schaltelements erforderliche Steuersignal, im Falle eines Thyristors die Zündspannung, auch extern zugeführt werden.

Die Verwendung einer extern steuerbaren Bypassanordnung, ermöglicht den Aufbau einer Diodenlaseranordnung, die zusätzliche Diodenlaserbarren oder Diodenlaser enthält, die im Normalbetrieb ungenutzt, d. h. von der Bypassanordnung kurzgeschlossen sind. Im Falle eines Ausfalls eines Diodenlasers kann dieser überbrückt werden und der ungenutzte Diodenlaser durch

Öffnen des diesem zugeordneten Schaltelementes zugeschaltet
werden, so dass die Diodenlaseranordnung mit gleichen Betriebsparametern und gleicher Ausgangsleistung weiterbetrieben
werden kann.

- 25 In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Bypassanordnung zwischen den Kontakt- und Kühlplatten des Diodenlasers angeordnet, dies ermöglicht eine einfache Integration der Bypassanordnung in den Stapel.
- 30 Die Kühlung des Bypass-Elementes erfolgt vorteilhaft auf gleichem Wege wie die Kühlung des zu überbrückenden Diodenlasers.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind die Bypassanordnung und der Diodenlaser auf einem Chip integriert. Auf diese Weise ist der Fertigungsaufwand bei der Herstellung eines Diodenlaserstapels verringert.

5

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Ausführungsbeispiele der Zeichnung verwiesen. Es zeigen:

Fig. 1 eine Diodenlaseranordnung gemäß der Erfindung in einem 10 elektrischen Prinzipschaltbild,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Bypassanordnung,

Fig. 3 ein Diagramm, in dem die Strom-Spannungscharakteristik.
für einen Diodenlaser und für die Bypassanordnung gemäß Fig. 2 dargestellt ist,

Fig. 4 ein weiteres vorteilhaftes Ausführungsbeispiel für eine selbstschaltende Bypassanordnung,

20

Fig. 5 den Aufbau einer Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von aufeinander in einem Stapel angeordneten und elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern in einer Prinzipdarstellung.

25

30

Gemäß Fig 1 sind in einer Diodenlaseranordnung gemäß der Erfindung eine Mehrzahl von Diodenlasern 2 elektrisch in Reihe an eine Spannungsquelle U angeschlossen. Durch den auf diese Weise gebildeten Stapel, der bis zu mehrere hundert Diodenlaser 2 enthalten kann, fließt ein hoher elektrischer Strom I, der typischerweise zwischen 50 und 100 A beträgt. Im Normalbetrieb fällt dabei an jedem Diodenlaser 2 eine Spannung Up ab, die je nach Betriebsstrom und Diodenlaserausführung (z.B. Wel-

lenlänge) bei etwa 2 V liegt, Jedem Diodenlaser 2 ist eine Bypassanordnung 4 parallel geschaltet, die im Normalbetrieb (= nicht geschaltet, symbolisch veranschaulicht durch einen geöffneten Schalter) hochohmig ist, das heißt einen ohmschen Wi-5 derstand aufweist, der deutlich größer ist als der ohmsche Widerstand des Diodenlasers 2 bei dessen Normalbetrieb. Die Verlustleistungsaufnahme der nicht geschalteten Bypassanordnung ist somit kleiner als die Nenn-Leistungsaufnahme des Diodenlasers und beträgt vorzugsweise weniger als 1/10 der Leistungsaufnahme des Diodenlasers 2.

10

30

Der hochohmige Ausfall eines einzelnen Diodenlasers 2 führt zu einer Unterbrechung des Diodenlaser-Stromkreises, so dass ohne Bypassanordnung 4 die gesamte Betriebsspannung U über dem aus-15 gefallenen Diodenlaser 2 anstehen würde. In einem solchen Fall wird der betroffene Diodenlaser 2 durch die ihm zugeordnete Bypassanordnung 4 niederohmig überbrückt (die Bypassanordnung wird zugeschaltet), so dass der Stromfluss durch die übrigen Diodenlaser 2 in nahezu unveränderter Höhe aufrecht erhalten 20 wird. Unter dem Begriff "niederohmig" ist dabei ein Widerstandswert zu verstehen, der den Widerstand, den der Diodenlaser 2 im Normalbetrieb aufweisen würde, nicht wesentlich überschreitet. Besonders vorteilhaft sind Bypassanordnungen 4, deren Widerstand bei Ausfall des Diodenlasers 2 deutlich nied-25 riger als der Widerstand des Diodenlasers im Normalbetrieb ist.

Als Bypassanordnung 4 ist grundsätzlich jede elektrische Schaltung geeignet, die die Funktion eines steuerbaren Schalters erfüllt, d. h. ein steuerbares Schaltelement, beispielsweise einen Transistor oder einen Thyristor, enthält. Das zur Steuerung erforderliche Steuersignal S kann dabei extern durch eine Steuer- und Auswerteeinrichtung 6 generiert werden, die

den an den Diodenlaser 2 jeweils anstehenden Spannungsabfall U_D überwacht und den ausgefallenen Diodenlaser 2 oder die ausgefallenen Diodenlaser 2 identifiziert. Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich, die Überwachung des korrekten Betriebs des jeweiligen Diodenlasers 2 auch innerhalb der Bypassanordnung 4 durchzuführen, d. h. das zum Steuern des steuerbaren Schaltelementes erforderliche Steuersignal S wird nicht extern sondern intern in der Bypassanordnung 4 generiert. Die Bypassanordnung 4 ist in diesem Fall selbstschaltend.

10

15

Mit einer extern steuerbaren Bypassanordnung 4 ist es möglich, gezielt einige der Diodenlaser 2 kurzzuschließen, um bei Ausfall eines oder mehrerer Diodenlaser 2 eine entsprechende Anzahl dieser kurzgeschlossenen Diodenlaser 2 durch Öffnen der Bypassanordnung 4 zuzuschalten.

Gemäß Fig. 2 ist als Bypassanordnung 4 eine aus mehreren Dioden 8 aufgebaute Schaltung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine aus passiven (nicht steuerbaren) Bauelementen aufgebaute selbstschaltende Bypassanordnung 4, die ohne aktive Bereitstellung eines externen oder internen Steuersignals im Fall eines Hochohmigwerdens des Diodenlasers selbst niederohmig wird. Mit der in der Figur dargestellten Reihenschaltung der Dioden 8 kann auf geeignete Weise eine Strom-Spannungs-Charakteristik erzeugt werden, wie sie in Fig. 3 dargestellt ist. In diesem Diagramm ist der Strom I, der durch das aus Diodenlaser 2 und der dazu parallel geschalteten Bypassanordnung 4 gebildete Bauteil fließt, gegen die Spannung UD aufgetragen. Kurve a zeigt die Strom-Spannungs-Charakteristik eines intakten Diodenlasers. Kurve b gibt die Strom-Spannungs-30 Charakteristik der aus einer Reihenschaltung von Dioden bestehenden Bypassanordnung 4 an. Die Bypassanordnung 4 muss dabei so dimensioniert sein, dass ihre Schwellspannung Us größer ist

als die maximale Betriebsspannung Umax des Diodenlasers. Mit anderen Worten: Die Bypassanordnung 4 ist im Betriebsbereich des Diodenlasers 2 hochohmig und wird bei Spannungen, die diesen Betriebsbereich überschreiten niederohmig. Dadurch entsteht im Betriebsbereich des Diodenlasers 2 in der Bypassanordnung 4 ein nur vernachlässigbarer ohmscher Verlust. Im Ausführungsbeispiel ist der differentielle Widerstand der Bypassanordnung 4 bei Ausfall des Diodenlasers 2 etwa gleich groß. Zur Aufrechterhaltung eines konstanten Stromflusses Io durch den Stapel muss die Spannung UD über dem aus defektem Diodenla-10 ser 2 und Bypassanordnung 4 bestehenden Bauteil des Stapels etwas ansteigen. Entsprechend der höheren Potentialdifferenz UD.1 > UD.0 über dem Bauteil wird somit bei gleichem Strom Io im Bauteil eine etwas höhere Leistung umgesetzt. Im Falle einer Regelung der Laserausgangsleistung des Diodenlaseranordnung wird der durch diese fließende Strom I zusätzlich etwas erhöht.

Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 enthält die Bypassanordnung 4 einen der Laserdiode 2 elektrisch parallel geschalteten 20 Thyristor 10 (p-Typ), dessen Gate (Steuerelektrode) über eine Zenerdiode 12 an die Anode des Diodenlasers 2 angeschlossen ist. Die Zenerdiode 12 verhindert ein Zünden des Thyristors 12 im Normalbetrieb. Steigt die Spannung an der Anode des Dioden-25 lasers 2 infolge eines hochohmigen Defektes an und überschreitet die Zenerspannung der Zenerdiode 12. fließt ein Steuerstrom zum Gate des Thyristors 10, der dann zündet und die Laserdiode 2 überbrückt. In diesem Aufbau ist die Bypassanordnung 4 selbstschaltend und die Steuerelektrode des Thyristors wird direkt (Schaltungsaufbau ohne Zenerdiode) oder indirekt 30 über die an der Laserdiode 2 anliegende Anodenspannung beeinflusst. Grundsätzlich kann jedoch das Gate des als steuerbaren Schalter dienenden Thyristors auch über eine externe Steuerspannung geschaltet werden.

Gemäß Fig. 5 sind eine Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern 2 in einem Stapel angeordnet. Im Ausführungsbeispiel bilden die übereinander angeordneten Diodenlaser 2 ein vertikales Stack. Jeder Diodenlaser 2 umfasst einen Diodenlaserbarren 20, der sich zwischen metallischen, vorzugsweise aus Kupfer bestehenden Kontaktplatten 22 befindet, 10 die zugleich als Wärmesenken dienen und insbesondere im Hochleistungsbereich zusätzlich Mikrokanäle aufweisen und durch ein Kühlfluid gekühlt werden. Der Diodenlaserbarren 20 ist zwischen die Kontaktplatten 22 gelötet. Neben dem Diodenlaserbarren 20 ist in den Aufbau die Bypassanordnung 4 zwischen die 15 als p- bzw. n-Kontakt dienenden Kontaktplatten 10 eingelötet.

Bezugszeichenliste

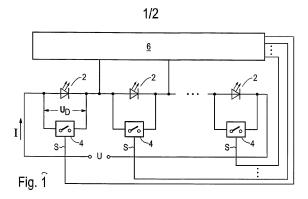
	2	Diodenlaser
5	4	Bypassanordnung
	8	Dioden
	10	Thyristor
	12	Zenerdiode
	20	Diodenlaserbarren
10	22	Kontaktplatten
	Us	Schwellspannung
	$\mathtt{U}_\mathtt{D}$	Spannung
15	\textbf{U}_{max}	maximale Betriebsspannung
	υ	Spannungsquelle
	I	Strom

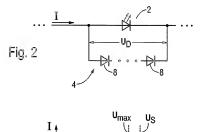
10

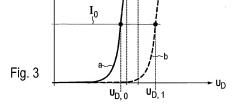
Ansprüche

- 5 1. Diodenlaseranordnung mit einer Mehrzahl von elektrisch in Reihe geschalteten Diodenlasern (2), denen jeweils eine Bypassanordnung (4) elektrisch parallel geschaltet ist, die im Normalbetrieb hochohmig ist und den jeweiligen Diodenlaser (2) im Falle eines hochohmigen Defektes niederohmig überbrückt.
 - 2. Diodenlaseranordnung nach Anspruch 1, bei der die Bypassanordnung (4) selbstschaltend ist.
- Diodenlaseranordnung nach Anspruch 2, bei der die Bypassanordnung (4) eine Diode oder eine Kombination mehrerer Dioden enthält, die bei einer Spannung im Betriebsbereich des Diodenlasers (2) hochohmig ist.
- 4. Diodenlaseranordnung nach Anspruch 2, bei der die Bypassanordnung (4) einen Thyristor (10) oder eine Kombination von Thyristoren enthält, deren Steuerelektrode direkt oder indirekt über die an der Anode des Diodenlasers (2) anliegende Anodenspannung beeinflusst wird.
- 5. Diodenlaseranordnung nach Anspruch 1, dessen Bypassanordnung (4) ein extern steuerbares Schaltelement (5) enthält.
- Diodenlaseranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bypassanordnung (4) zwischen den Kontaktplat-30 ten des Diodenlasers (2) angeordnet ist.

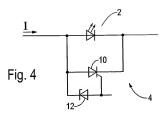
- 7. Diodenlaseranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bypassanordnung (4) und der Diodenlaser (2) auf einem Chip integriert sind.
- 8. Diodenlaseranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bypassanordnung (4) und der Diodenlaser (2) als einzelne Bauelemente auf einem gemeinsamen Kühl- und Kontaktelement angeordnet sind.

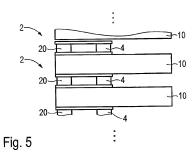












Internation Application No

Relevant to daim No.

1.5

1,5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01S5/068 H01S5/42

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

figures 6,7

H05B33/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

χ

Minimum documentation searched (classification system followed by dessification symbols) IPC 7-H01S-H01L-H05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

Category . Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

EP 0 878 880 A (CONTRAVES AG)

18 November 1998 (1998-11-18) column 8, line 25 -column 9, line 23;

GB 2 278 717 A (FUJITSU LTD)

7 December 1994 (1994-12-07) page 3, line 26 -page 6, line 12

	page 7, line 13 -page 11, line 1,7	21; figures	:
X	US 6 259 714 B1 (KINBARA YOSHI 10 July 2001 (2001-07-10) column 4, line 60 -column 6, l figures 1,5,8		1–3
		-/	
χ Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider of "E" earlier of filing of "L" docume which citation "O" docume other is "P" docume later the	est which may throw doubts on profity daim(s) or is clied to establish the publication diale of another or or other special reason (as specified) ent reterring to an oral disclosure, use, exhibition or means or published prior to the International filing date but han the priority date claimed	The later document published after the but close the control of th	the application but soon underlying the claimed invention is considered to cument is taken alone cument is taken alone callened invention ventive step when the ventive step when the ventive step when the ventile step when the set to a person selled family
Dale of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se-	arch report
6	June 2003	20/06/2003	
Name and r	mailing address of the ISA European Palent Orlice, P.B. 5618 Palentiasn 2 NL - 2280 FW Pijawlk Tel. (+31-70) 340-2240, Tx. 31 651 epo ni, Fax (+31-70) 340-3016	Authorized officer Gnugesser, H	
Form PCT/ISA/	Fax: (+31-70) 340-3016 210 (second sheel) (July 1662)	· anagesser, n	

Internate Application No PCT/EP 03/02016

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
1	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 05, 3 May 2002 (2002-05-03) -& JP 2002 025784 A (ISHIZAWA TAKASHI), 25 January 2002 (2002-01-25) abstract	1-3,5,8
•	DE 100 36 283 A (BOSCH GMBH ROBERT) 7 February 2002 (2002-02-07) column 1, line 19 -column 2, line 1 column 2, line 42 -column 3, line 6; claim 7; figures 3,4	1,5,8
(PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 221 (E-271), 9 October 1984 (1984-10-09) -å JP 59 103565 Å (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15 June 1984 (1984-06-15) abstract	1-3
A	DE 198 41 490 A (SIEMENS AG) 23 March 2000 (2000-03-23) column 4, line 20 -column 7, line 66; figure 2	1-3
A	EP 0 967 590 A (HEWLETT PACKARD CO) 29 December 1999 (1999-12-29) column 5, line 16-57; figure 2	1,5
Α	EP 0 129 498 A (SIEMENS AG) 27 December 1984 (1984-12-27) page 2, line 1-5 page 3, line 1 -page 4, column 2; figure 1	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT In a mation on patent family members

Internation Application No PCT/EP 03/02016

					01/ 11	00, 02010
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 0878880	A	18-11-1998	CA DE EP JP US	2234854 59800382 0878880 11026852 6018602	D1 A1 A	25-12-1998 18-01-2001 18-11-1998 29-01-1999 25-01-2000
GB 2278717	A	07-12-1994	JP JP US	2991893 6338647 5459328	A	20-12-1999 06-12-1994 17-10-1995
US 6259714	B1	10-07-2001	JP CN DE TW US	11087817 1211093 19840514 412890 6135552	A A1 B	30-03-1999 17-03-1999 18-03-1999 21-11-2000 24-10-2000
JP 2002025784	A	25-01-2002	NONE			
DE 10036283	A	07-02-2002	DE EP	10036283 1182757		07-02-2002 27-02-2002
JP 59103565 4	A		NONE			
DE 19841490	A	23-03-2000	DE	19841490	A1	23-03-2000
EP 0967590	A	29-12-1999	EP JP US	0967590 2000029400 6239716	A	29-12-1999 28-01-2000 29-05-2001
EP 0129498	A	27-12-1984	DE AT DE EP	3319779 24789 3461959 0129498	T D1	29-11-1984 15-01-1987 12-02-1987 27-12-1984

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation es Aktenzeichen PCT/EP 03/02016

Betr. Anspruch Nr.

1,5

1.5

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01S5/068 H01S5/42 H05B33/08

Nach der internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Х

χ

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \quad H01S \quad H01L \quad H05B$

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Abbildungen 6,7

Becherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evfl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

EP 0 878 880 A (CONTRAVES AG)

GB 2 278 717 A (FUJITSU LTD)

7. Dezember 1994 (1994-12-07) Seite 3, Zeile 26 -Seite 6, Zeile 12

18. November 1998 (1998-11-18) Spalte 8, Zeile 25 -Spalte 9, Zeile 23;

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, sowell erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle

	Seite 7, Zeile 13 -Seite 11, Zei Abbildungen 1,7					
X	US 6 259 714 B1 (KINBARA YOSHIHII 10. Juli 2001 (2001-07-10) Spalte 4, Zeile 60 -Spalte 6, Ze Abbildungen 1,5,8	1-3				
X Weit	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Palentfamilie				
"A" Veröffe aber n "E" älteres Anmel "I." Veröffen sondern soll och ausge "O" Veröffe eine B	** Flacesdorer Kalapylen von angegebasen Veröffentlichungen : ***Neröfentlichung, die nach dem indermalensten Ammeldedum oder ein Produktier der einst als bezonden bedreiben anzureinen Kand der Tochark derheint, der ein ein dem in der nach dem internationalen Ammeldedum veröffentlicht worden ist und mit der Ammelden grickt des jeden der sich mit den bezondens bedreiben modern nicht als bezondens bedreiben den keiner horditätensprecht zweitelbatt er schleine zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer auch den in Herherheinberückt gewennen Veröffentlichung beitig werden zu des sehen heiner des Sentrations veröffentlichten gestellt der sich den zu den der Veröffentlichung von besonderer Bedautung: die bauspruchte Effinde und seinen Bedautung, die nach auf eine mit der Veröffentlichung von besonderer Bedautung: die bauspruchte Effinde kann albeit auf unt dieser Veröffentlichung des veröffentlichten					
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts						
6	. Juni 2003	20/06/2003				
Name und F	Posianschrilt der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NI. – 2208 IV Plijswijk Tel. (-31–70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fac. (431–70) 340-2018	Bevollmächtigter Bediensteter Gnugesser, H				
Formblatt PGT/I	(SA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/02016

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Y Y A A A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 05, 3. Mai 2002 (2002-05-03) -å JP 2002 025784 A (ISHIZAWA TAKASHI), 25. Januar 2002 (2002-01-25) Zusammenfassung DE 100 36 283 A (BOSCH GMBH ROBERT) 7. Februar 2002 (2002-02-07) Spalte 1, Zeile 19 -5palte 2, Zeile 1 Spalte 2, Zeile 42 -5palte 3, Zeile 6; Anspruch 7; Abbildungen 3,4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 221 (E-271), 9. Oktober 1984 (1984-10-09) -å JP 59 103565 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15. Juni 1984 (1984-06-15) Zusammenfassung DE 198 41 490 A (SIEMENS A6) 23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2 EP 0 967 590 A (HEMLETT PACKARD CO)	1-3,5,8 1,5,8 1-3
Y Y	vol. 2002, no. 05, 3. Mai 2002 (2002-05-03) -& JP 2002 025784 A (ISHIZAWA TAKASHI), 25. Januar 2002 (2002-01-25) Zusammenfassung DE 100 36 283 A (BOSCH GMBH ROBERT) 7. Februar 2002 (2002-02-07) Spalte 1, Zeile 19 -Spalte 2, Zeile 1 Spalte 2, Zeile 42 -Spalte 3, Zeile 6; Anspruch 7; Abbildungen 3,4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 221 (E-271), 9. Oktober 1984 (1984-10-09) -& JP 59 103565 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15. Juni 1984 (1984-06-15) Zusammenfassung DE 198 41 490 A (SIEMENS AG) 23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2	1,5,8
Y	7. Februar 2002 (2002-02-07) Spalte 1, Zeile 19 -Spalte 2, Zeile 1 Spalte 2, Zeile 42 -Spalte 3, Zeile 6; Anspruch 7; Abbildungen 3,4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 221 (E-271), 9. Oktober 1984 (1984-10-09) -8 JP 59 103565 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15. Juni 1984 (1984-06-15) Zusammenfassung DE 198 41 490 A (SIEMENS A6) 23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2	1-3
A	vol. 008, no. 221 (E-271), 9. Oktober 1984 (1984-10-09) -& JP 59 103565 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 15. Juni 1984 (1984-06-15) Zusammenfassung DE 198 41 490 A (SIEMENS AG) 23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2	
A	23. März 2000 (2000-03-23) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 7, Zeile 66; Abbildung 2	1-3
	EP 0 967 590 A (HEWLETT PACKARD CO)	
A	29. Dezember 1999 (1999-12-29) Spalte 5, Zeile 16-57; Abbildung 2	1,5
	EP 0 129 498 A (SIEMENS AG) 27. Dezember 1984 (1984-12-27) Seite 2, Zeile 1-5 Seite 3, Zeile 1 - Seite 4, Spalte 2; Abbildung 1	1

INTERNATIONALER BECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen zur selben Patentfamilie gehören

Internations Aldenzeichen
PCT/EP 03/02016

						0.,	00, 02020
	echerchenbericht rtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0878880	A	18-11-1998	CA DE EP JP US	2234854 59800382 0878880 11026852 6018602	D1 A1 A	25-12-1998 18-01-2001 18-11-1998 29-01-1999 25-01-2000
GB	2278717	A	07-12-1994	JP JP US	2991893 6338647 5459328	A	20-12-1999 06-12-1994 17-10-1995
US	6259714	В1	10-07-2001	JP CN DE TW US	11087817 1211093 19840514 412890 6135552	A A1 B	30-03-1999 17-03-1999 18-03-1999 21-11-2000 24-10-2000
JP	2002025784	A	25-01-2002	KEIN	VE		
DE	10036283	A	07-02-2002	DE EP	10036283 1182757		07-02-2002 27-02-2002
JP	59103565 4	A		KEI	NE		
DE	19841490	A	23-03-2000	DE	19841490	A1	23-03-2000
EP	0967590	A	29-12-1999	EP JP US	0967590 2000029400 6239716	A	29-12-1999 28-01-2000 29-05-2001
EP	0129498	A	27-12-1984	DE AT DE EP	3319779 24789 3461959 0129498	T D1	29-11-1984 15-01-1987 12-02-1987 27-12-1984